

Влияние технологического микроклимата на качество изделий микроэлектроники

Kaipoksin, L.; Puusepp, Ü.; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1983 / с. 76-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Качество деионизированной воды, используемой в производстве микросхем

Puusepp, Märt; Frid, M.; Hansen, Eerik; Hödrejärvi, Helvi Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1978 / с. 75-76 https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Система контроля микроклимата в производстве интегральных схем

Hansen, Eerik; Puusepp, Märt Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1971 / с. 88-92 https://www.ester.ee/record=b1802011*est